

## パルスレーザー加工システム（レーザー装置1：AVESTA

## PROJECT社製フェムト秒レーザー、レーザー装置2：EKSPLA社製ピコ秒レーザー）

製造元	レーザー装置1：AVESTA PROJECT、レーザー装置2：EKSPLA
仕様	レーザー装置1：FREGAT、波長1235nm、パルス幅<120fs レーザー装置2：ATLANTIC、波長1064/532nm、パルス幅<13ps
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/</a>
注意事項等	利用申請前に利用の概略を下記連絡先に必ずお知らせいただき承認を得てください。
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 准教授 下間靖彦 shimotsuma.yasuhiko.3m(at)kyoto-u.ac.jp 075-383-2460 <a href="http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/">http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/</a> 利用申請前に利用の概略をこちら宛に必ずお知らせいただき承認を得てください。
キーワード	超短パルスレーザー、微細加工
機器コード	0000110001
自由記入欄	フェムト秒およびピコ秒パルスレーザーによる加工が可能です。



AVESTA PROJECT社製FREGAT



EKSPLA社製ATLANTIC